

会 告

「第36回 真空展 VACUUM2014」併催「真空トピックス」 日本真空学会 スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会 (SP 部会) 第140回定例研究会・ISSP2015プレセッション ～スマート社会を実現するためのマイルストーン—2020年へ向けて—

スパッタリングを中心としたプラズマプロセスは、古くから様々なデバイス・製品に応用され、現在も産業にとって欠かすことのできないキーテクノロジーとなっています。International Symposium on Sputtering and Plasma Processes (ISSP)は、第1回目の開催となった1991年以降、20年以上の長きに渡り、基礎研究、材料開発から、製品化技術に至る幅広い情報を交換・議論する場を提供して参りました。隔年開催で13回目を迎えるISSP2015を来年7月に開催する予定としております。これに先立ち、SP部会の定例研究会としてISSP2015プレセッションを開催致します。「スマート社会を実現するためのマイルストーン—2020年へ向けて—」というメイントピックのもと、様々な産業分野・各種デバイス開発の第一線でご活躍の研究者・技術者の方々に講演を頂きます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日 時：2014年10月15日（水）13：00～16：35（受付 12：30～）

場 所：東京ビッグサイト 会議棟606会議室

—講演プログラム—

開会の挨拶 ISSP2015実行委員長	(セントラル硝子株式会社) 加藤和広	13：00～13：10
「成膜技術を用いたデバイス開発と人センシングへの応用」	(東京医科歯科大学) 三林浩二	13：10～13：55
「半導体技術を活用したメディカルデバイス・システム (仮題)」	(ローム株式会社) 丹羽大介	13：55～14：40
	(休憩 14：40～15：00)	
「欧州のフレキシブルエレクトロニクス関連技術開発動向と日本」	(株式会社サーフテックトランスナショナル) 鈴木巧一	15：00～15：45
「生活支援ロボットの実用化の問題点～生活支援ロボット安全検証センターの紹介を通じて～」	(産業技術総合研究所) 大場光太郎	15：45～16：30
閉会の挨拶	日本真空学会 スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会 部会長 (東海大学) 沖村邦雄	16：30～16：35

※講演が追加となった場合、プログラムの時間に変更があります。ご了承下さい。

参加費（予稿集代・消費税を含む）当日受付にて、お支払いください。

スパッタリングおよびプラズマプロセス技術部会会員	無料
日本真空学会・日本真空工業会会	3,000円
一般	5,000円
学生	1,000円

※お申込はWEBより事前に行ってください。余席があれば当日も受け付けます。

真空展 VACUUM2014 URL：<http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>

問い合わせ先

(一社)日本真空学会事務局 TEL：03-3431-4395 FAX：03-3433-5371

E-mail：ofc-vs@vacuum-jp.org